

ダイジェストカタログ

令和版

フィルメトリクス株式会社では、長年に亘り光学式膜厚測定装置を販売し、国内の大学・官公庁をはじめとする研究機関や、半導体・化学材料・医療・自動車関連等様々な企業で御使用頂いております。

3次元表面形状測定システム

Profilm3D

表面形状・段差・粗さ測定システムを身近に！

洗練された白色干渉法 (WLI) と位相シフト法 (PSI) の両方の測定機能を搭載した3次元表面形状測定システムです。
1台でナノオーダーの表面粗さからミリオーダーの形状段差測定まで可能です。
コンパクトで操作性に優れ、高精度かつスピーディーな測定を実現したシステムです。

仕様

<測定>

- ・ 段差測定範囲 ~ 10 mm
- ・ 段差測定正確性 0.7%
- ・ 段差測定再現性 0.1%
- ・ 反射率対応範囲 0.05% - 100%

<レンズ>

- ・ 測定エリア 0.2×0.17 mm
 ~ 4.0×3.4 mm
- ・ XY 分解能
 (サンプリング間隔) 最小 0.4μm
 最小 0.088μm

<装置>

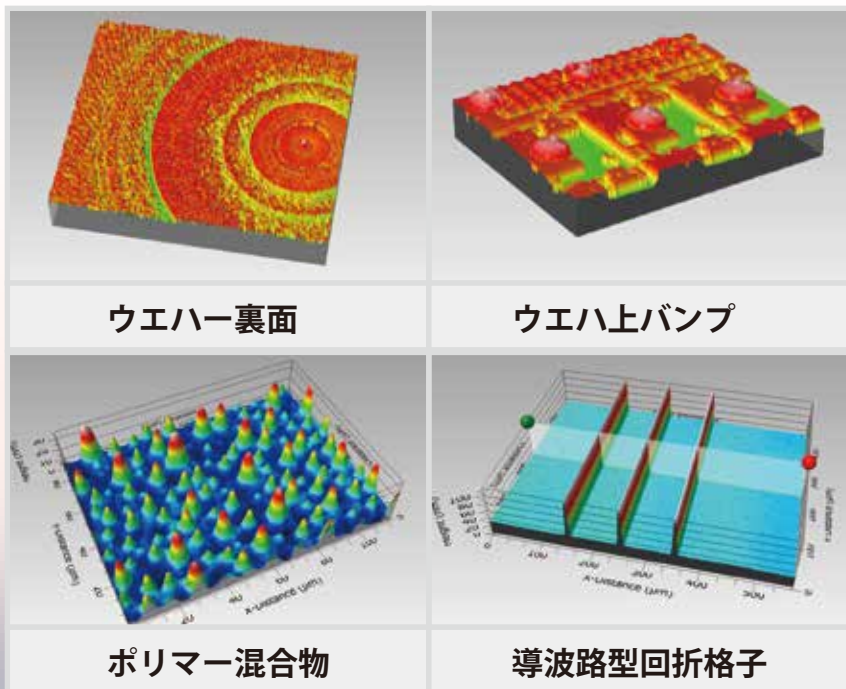
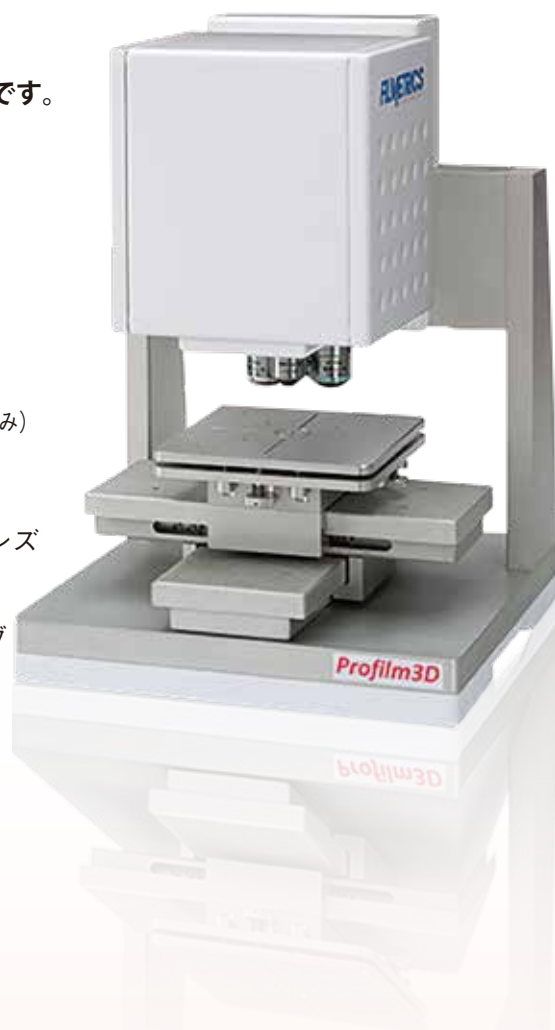
- ・ 測定ステージ 100×100 mm
- ・ Z軸駆動範囲 100 mm
- ・ スキャンスピード 2μm/秒
- ・ 寸法 (D)×(W)×(H) 300×300×550 mm

本体一式

- ・ Profilm3D 装置本体
- XY 自動測定ステージ
- 手動レボルバー
- 干渉レンズ (10倍レンズ)
- ・ 装置制御用 PC
(Profilm3D 専用解析ソフトウェア搭載済み)
- ・ 段差標準サンプル (10μm)

オプション

- ・ 5倍、20倍、50倍、100倍レンズ
- ・ ステッチングソフトウェア
(貼り合せ機能)
- ・ トータルフォーカスカラーイメージング
- ・ アクティブ除振台



ウェハー裏面

ウェハ上バンプ

ポリマー混合物

導波路型回折格子

Z軸 駆動範囲 100 mm	段差測定 数 nm ~10 mm	XY自動 ステージ 100×100 mm	4孔 レボルバー
位相シフト 干渉法	ピエゾ 駆動範囲 500 μm	測定視野 0.2×0.17 mm ~ 4.0×3.4 mm	レンズ 5-100倍
粗さ測定	スキャン 12μm/秒	ステッチング 機能	アクティブ 除振台

膜厚測定システム

本内容は改良の為予告なく変更する場合があります。

標準仕様 選択オプション 追加オプション

膜厚測定システム

F20

世界中で 5000 台以上使用されているベーシックモデル！

仕様

- 膜厚測定範囲 1nm ~ 250 μ m
- 測定波長領域 190 -1700nm
- 膜厚測定正確性 膜厚の $\pm 0.2\%$, ≥ 1 nm
- 測定スポット径 標準 $\phi 1.5$ mm (最小 $\phi 0.1$ mm)



シングルポイント測定	反射率測定	測定スポット $\phi 1.5$ mm
ステージ 152 \times 152 mm	透過率測定	測定スポット 最小 $\phi 0.1$ mm
膜厚 1nm ~250 μ m	12inch 回転ステージ	曲面サンプル

顕微鏡式膜厚測定システム

F40

最小 $\phi 0.5\mu$ m の微小領域で膜厚測定が可能！

仕様

- 膜厚測定範囲 4nm ~ 120 μ m
- 測定波長領域 190 -1700nm
- 膜厚測定正確性 膜厚の $\pm 0.2\%$, ≥ 1 nm
- 測定スポット径 $\phi 0.5\mu$ m - 100 μ m



シングルポイント測定	反射率測定	測定スポット $\phi 0.5-100\mu$ m
Cマウント 観察用カメラ	紫外/近赤外対応顕微鏡	顕微鏡アパーチャ 50~500 μ m
膜厚 4nm ~120 μ m	汎用顕微鏡取付(可視)	対物レンズ 5~100倍

自動マッピング膜厚測定システム

F50

膜厚分布を 2D または 3D のカラーマップで表示可能！

仕様

- 膜厚測定範囲 1nm ~ 250 μ m
- 測定波長領域 190 -1700nm
- 膜厚測定正確性 膜厚の $\pm 0.2\%$, ≥ 1 nm
- 測定スポット径 標準 $\phi 1.5$ mm (最小 $\phi 0.1$ mm)



多点測定	反射率測定	測定スポット $\phi 1.5$ mm
自動回転ステージ	2D・3D マッピング	測定スポット 最小 $\phi 0.1$ mm
膜厚 5nm ~250 μ m	チャック 2inch ~ 450 mm	インターロックカバー

フィルメトリクス株式会社

〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-5-9 新横浜フジカビル 8階

info@filmetrics.co.jp www.filmetrics.co.jp

Tel 045-473-7109

Fax 045-473-7209